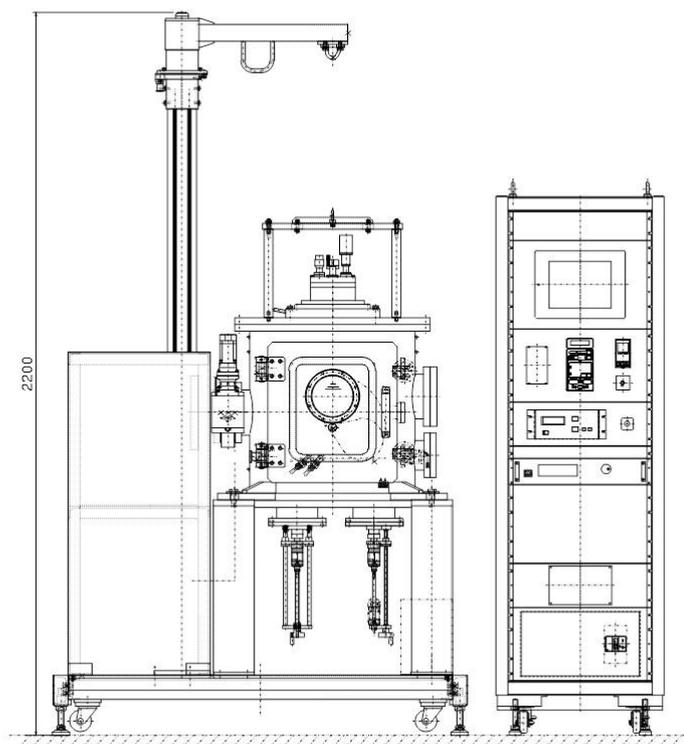


# 磁控溅射镀膜设备 Sputtering System



型号：ASP-443-2



设备的详细指标及其它型号欢迎来电咨询

设备名称	磁控溅射镀膜设备（平行对向）	备注
型号	ASP-443-2	
概要	镀膜室尺寸：550 (ID) X 600 (H) mm	表面喷砂、水冷
	水冷磁控靶：直径4英寸 3台	配自动挡板
	磁控电源：1000W射频电源、自动匹配器	电源功率数量可调整
	衬底：4英寸、加热温度高于500	衬底可自公转
	镀膜室真空度：小于 $5 \times 10^{-5}$ Pa	可选择抽气方式
	工作气体：3路、质量流量计控制	根据需要可调整
	选配：准备室，辅助离子源等	
尺寸及电源	尺寸：240 (长) X 150 (宽) X 240 (高) CM	电源：单相 220V 60A

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.  
TEL: 06-6707-5888 E-mail: [info@anseitech.com](mailto:info@anseitech.com)